



产品优势

1. 对光源直接成像

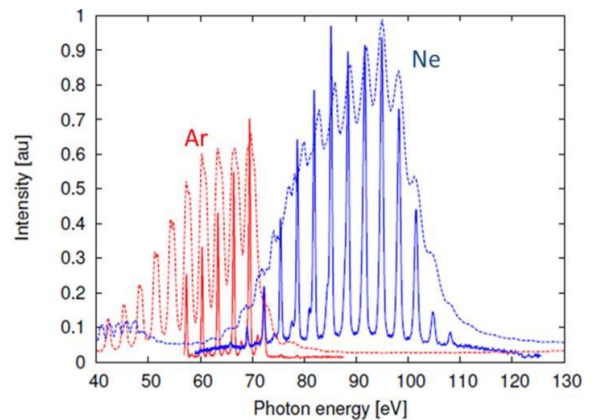
- 1-200nm光谱范围的平场光谱仪
- 通过无狭缝设计实现一流的效率：不使用对准敏感的窄入口狭缝
- 与标准光谱仪相比，光收集量增加约20倍，从而使信噪比成比例提高

2. 准确 高效

- 绝对光栅位置监控，用于保持光栅对齐
- 高效率像差校正平场光栅
- 集成光束质量分析仪
- 双杂散光滤光片
- 软件控制方便

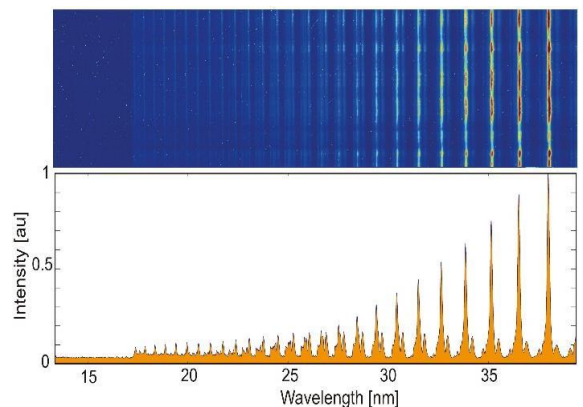
3. 定制化服务

- 光谱仪经过定制以精确匹配所需的应用场景
- 可连接实验室其它设备
- 定制的设备结构尺寸
- 用户自定义的滤光片安装接口



样品测量表明提高了收集的信号强度。在相同的信号强度下，maxLIGHT（实线）的分辨率明显高于标准光谱仪（虚线）的分辨率。对于同样分辨率，标准技术需要设置一个狭缝，因此信号强度会显著降低。专有的无狭缝技术可同时提供高分辨率和高信号强度。

(数据由Prof. C. Hauri提供，Paul Scherrer研究所)



样品测量展示了maxLIGHT的分辨率性能。所示的高次谐波光谱是由单个飞秒激光脉冲与固体靶相互作用和随后的光谱滤波产生的。远紫外光谱仪清楚地解析了产生过程中固有的子结构。

(Plasma Phys. Control. Fusion 53 124021 (2011))

规格参数

项 目	内 容
系统	像差校正平场光谱仪和光束质量分析仪
波长范围	1-200nm
光源距离	可变
探测器	CCD或MCP/CMOS
真空压强	<10 ⁻⁶ mbar (提供超高压版本)
无狭缝技术	是
入口狭缝	可选
光栅调节方式	电动闭环
光谱滤波器插入选项	是
控制接口	USB或以太网
软件	Windows UI和Labview/VB/C/C SDK
客户定制服务	可定制
其他	非磁性, 尺寸定制, 偏振测定等

	SXR	XUV	VUV
波长范围	1-20nm	5-80nm	40-200nm
色散	0.2-0.4nm/mm	0.5-1.3nm/mm	0.9-1.6nm/mm
分辨率	<0.015nm@10nm	<0.028nm@40nm	<0.05nm@120nm